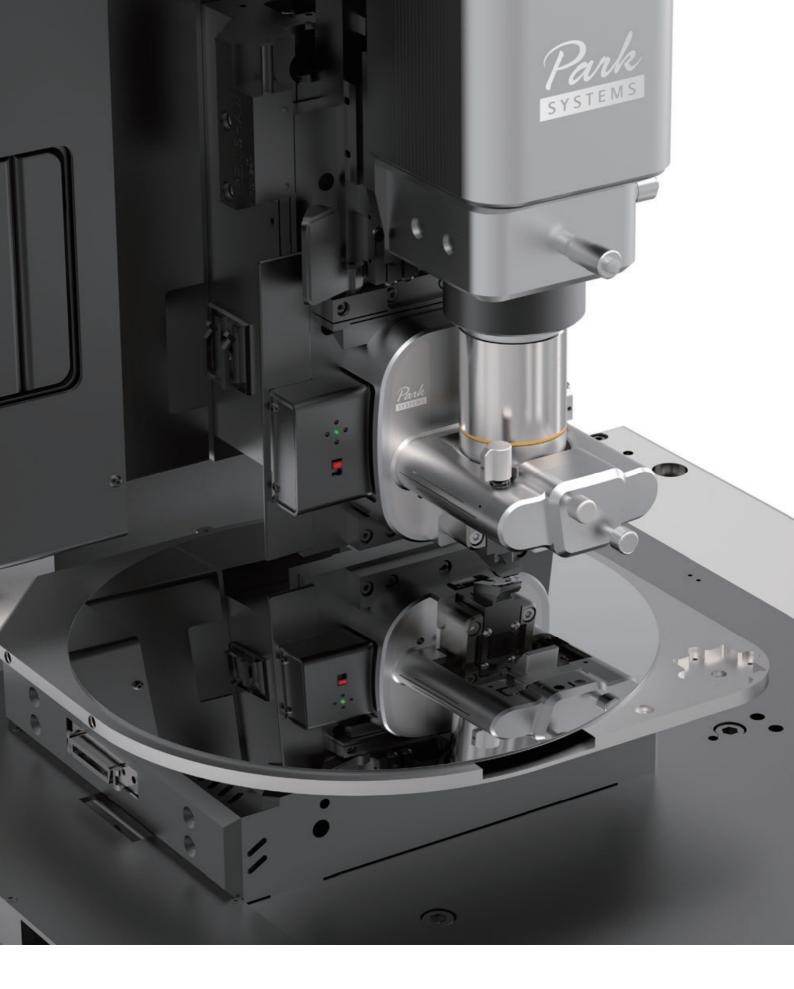


Лучший инструмент в нанометрологии для анализа дефектов и исследования крупных образцов





Park Systems Самый точный атомно-силовой микроскоп

Самый точный атомно-силовой микроскоп

Park NX20

Идеальный выбор для анализа дефектов

Инженерам-исследователям требуется получать надежные результаты и данные. Модель ParkNX20 имеет репутацию самого точного атомно-силового микроскопа в мире для анализа крупных образцов, поэтому он получил широкое распространение в индустрии жестких дисков и полупроводников.

Мощное решение для анализа дефектов

Данный ACM оснащается компонентами уникальной конструкции, которые облегчают использование микроскопа при поиске дефектов устройств и разработке креативных проектов. Непараллельная конструкция обеспечивает получение данных с высоким разрешением, которые позволяют Вам уделить основное внимание решению исследовательских задач. Режим True Non-ContactTM делает работу зонда более четкой и продолжительной, это экономит Ваши время и деньги на обслуживание.

Прост в работе даже для молодого специалиста

Park NX20 имеет самый удобный дизайн и автоматизированный интерфейс в индустрии, поэтому не потребуется тратить много времени и сил при работе с микроскопом и для обучения молодых специалистов. Это позволяет больше времени уделить исследовательской работе и решению сложных задач, и обеспечивает своевременный и качественный анализ дефектов.



Инновационный дизайн для решения самых современных задач

Точные ACM для FA и исследовательских лабораторий

- Измерение шероховатости поверхности для сред и подложек
- Анализ и получение обзорных изображений дефектов
- Режим электронного сканирования высокого разрешения
- Измерение боковых стенок при изучении трехмерных структур

Точные, воспроизводимые измерения для повышения производительности

- Бесконтактный режим для сохранения четкости зонда и обеспечения точности измерения шероховатости поверхности
- Быстрое получение изображений дефектов в бесконтактном режиме
- Система раздельного сканирования ХҮ для измерения трехмерных структур
- Минимальный сдвиг и гистерезис с использованием компонентов, имеющих аналогичные температурные характеристики

Точная топография АСМ с применением малошумного Z-детектора

- Топографические измерения производятся самым современным промышленным Z-детектором с низким уровнем шума
- Технология True Sample Topography[™] без смещения краев или ошибок, вызванных изменением характеристик пьезоэлемента
- Точная регистрация высоты поверхности даже в процессе высокоскоростного сканирования Компактный латеральный сканер ХҮ с синусоидальным алгоритмом сканирования при перемещении вперед
- Самый лучший критерий в отрасли шаг сканирования при перемещении зонда вперед и назад не превышает 0,15%

Экономия затрат при работе в режиме True Non-Contact™

- Увеличенный более чем в 10 раз срок службы зонда при эксплуатации и отображении дефектов
- Минимальный износ зонда, гарантия получения высококачественного изображения с высоким разрешением в течение длительного периода времени
- Минимальное нарушение или изменение поверхности образца

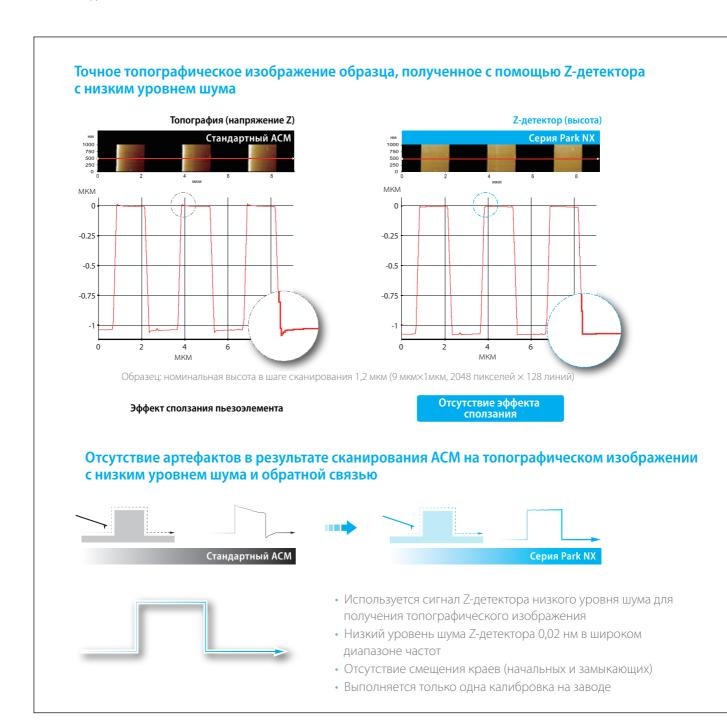




Технология АСМ

Лидирующий в отрасли малошумный Z-детектор

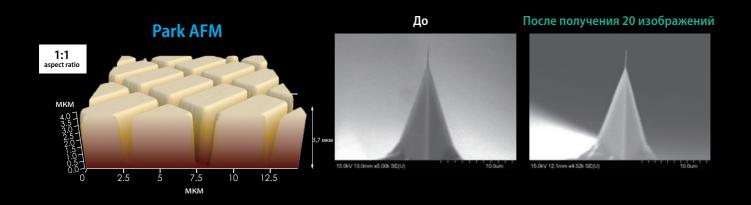
Наши АСМ оснащены самыми эффективными в отрасли Z-детекторами с низким уровнем шума. Уровень шума не превышает 0,02 нм в широком диапазоне частот. Это позволяет выполнять топографическое измерение образца с высокой точностью, без смещения краев и калибровки. Поэтому Park NX20 экономит время и выдает отличные данные.



Режим True Non-Contact™ сохраняет четкость показаний зонда

Наконечники (зонды) АСМ настолько хрупкие, что при их контакте с образцом происходит мгновенное снижение разрешения и качества изображения. При работе с мягкими и тонкими образцами зонд может повредить образец, это приведет к неточности измерений высоты профиля, повлечет рост затрат времени и денег.

Уникальный режим True Non-Contact™ ACM существенно увеличивает разрешение и точность полученных данных при сохранении целостности самого образца.



Точная обратная связь за счет скоростного сервопривода оси Z в режиме True Non-Contact



Полуконтактное изображение

- Быстрый износ зонда = размытое сканирование низкого качества
- Разрушающее образец взаимодействие зонд-образец = нарушение и изменение поверхности образца
- Высокая зависимость от параметров измерений



Режим True Non-Contact™

- Ниже износ зонда = длительное сканирование высокого разрешения
- Неразрушающий контакт зонд-образец = минимальное нарушение образца
- Невосприимчивость к параметрам измерений (при получении результатов)

АСМ, выполненный по самой передовой технологии

1Двумерный консольный сканер с диапазоном сканирования 100 мкм × 100 мкм

Латеральный сканер XY состоит из симметричной двумерной консоли и пьезоэлектрического блока высокого усилия. Он обеспечивает ортогональное перемещение с очень высоким разрешением в плоскости и существенное быстродействие.

2 Высокоскоростной Z сканер с 15 мкм диапазоном сканирования

Стандартный сканер Z, приводимый в действие пьезоэлектрическим блоком высокого усилия и направляемый консолью, имеет резонансную частоту выше 9 кГц (стандартное значение 10,5 кГц) и сверхвысокую скорость зонда более 48 мм/сек. Максимальный диапазон Z сканирования можно увеличить с 15 мкм до 30 мкм с помощью Z-сканера с увеличенным ходом.

ЗДатчики положения низкого уровня шума XYZ

Ведущий в отрасли малошумный Z-детектор заменил топографический сигнал напряжения Z, вместе с тем, малошумное латеральное сканирование XY с обратной связью сократило шаг сканирования при перемещении зонда вперед и назад до 0,15% во всем диапазоне сканирования.

Ф Моторизированный предметный столик XY

Применение кодирующих устройств позволяет точнее воспроизводить положение столика образца. Столик XY перемещается с точностью в 1мкм и воспроизводимостью положения в 2 мкм, столик перемещается вдоль оси Z с точностью в 0,1мкм и воспроизводимостью в 1мкм.

5 Автоматизация процесса поэтапного сканирования

С помощью предметного столика можно получить изображение в выбранной области сканирования. Вот как это работает:

- 1 Сканируется изображение
- 2 Производится подъем кантилевера
- **3** Перемещается моторизированный предметный столик в выбранное пользователем положение
- 4 Производится подведение зонда
- 5 Выполняется повторное сканирование

Процесс автоматизации значительно повышает производительность за счет снижения затрат времени на вмешательство оператора в процесс сканирования

6 Удобный держатель образца

Уникальная головка позволяет работать с образцом в форме подложки размером 200 мм и облегчает боковой доступ к образцу и зонду.



7 Слот для дополнительных режимов и опций SPM

Режимы SPM можно подключить после установки дополнительного модуля в расширительный слот микроскопа. Модульная конструкция NX-серий обеспечивает совместимость модулей всего модельного ряда.

8 Мощная осевая оптика со встроенным осветителем и ПЗС камерой



Специально разработанные объективы со сверхвысоким рабочим расстоянием (10^х, 51 мм, числовая апертура 0.21, разрешение 1 мкм) позволяют проводить наблюдение за исследуемой областью образца с высочайшей точностью. Получаемое изображение позволяет пользователю наводиться на ту зону образца, которая представляет для исследования наибольший интерес. Для получения еще более высокого разрешения и четкого изображения может использоваться объектив с увеличением 20^х (20 мм, числовая апертура 0.42, разрешение 0.7 мкм), оптимизированный под специальную измерительную головку. Специальная ПЗС камера с увеличенным детектором обеспечивает передачу изображения без потери разрешающей способности, а встроенный LED осветитель дополнительно позволяет отображать структуру поверхности с большей яркостью и контрастом.

9 Удобное крепление головки SLD по направляющей

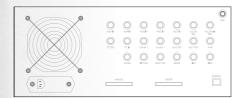
Сканирующая головка АСМ легко вставляется и извлекается простым движением вдоль направляющей. Замок автоматически блокирует головку в определенной позиции и подсоединяет ее к управляющей электронике с точностью в несколько мкм. Низкая когерентность пучка света сверхъяркого диода (SLD) позволяет получить точное изображение от отражающих поверхностей и выполнить измерение в пиконьютоновой силовой спектроскопии. Длина волны SLD устраняет эффект интерференции, это особенно удобно при проведении экспериментов в видимой части спектра.

Моторизированный Z и фокусный столики (автофокусирующая подача)

Оба столика соединяют кантилевер с поверхностью образца и постоянно поддерживают четкое изображение. Благодаря моторизации фокусного столика и программному управлению он обеспечивает необходимую точность для прозрачных образцов и жидкостных элементов.

Высокоскоростная 24-битная цифровая электроника

Все АСМ NX-серии контролируются и управляются одним и тем же электронным контроллером NX. Контроллер является цифровым, высокоскоростным 24-битным устройством, которое успешно реализует режим True Non-Contact™ с необходимой точностью и скоростью. Обладая малошумной конструкцией и высокоскоростным блоком обработки данных, контроллер является отличным решением для точного измерения токов и напряжений, а также получения изображений в нанометрическом диапазоне измерений. Возможность обработки цифровых сигналов добавляет функциональность и экономичность нашим АСМ при проведении исследований.



24-битное разрешение сигнала для ХҮ и Z-детекторов

- Разрешение в плоскости XY 0,003 нм (50 мкм XY)
- Разрешение в направлении оси Z 0,001 нм (15 мкм Z)

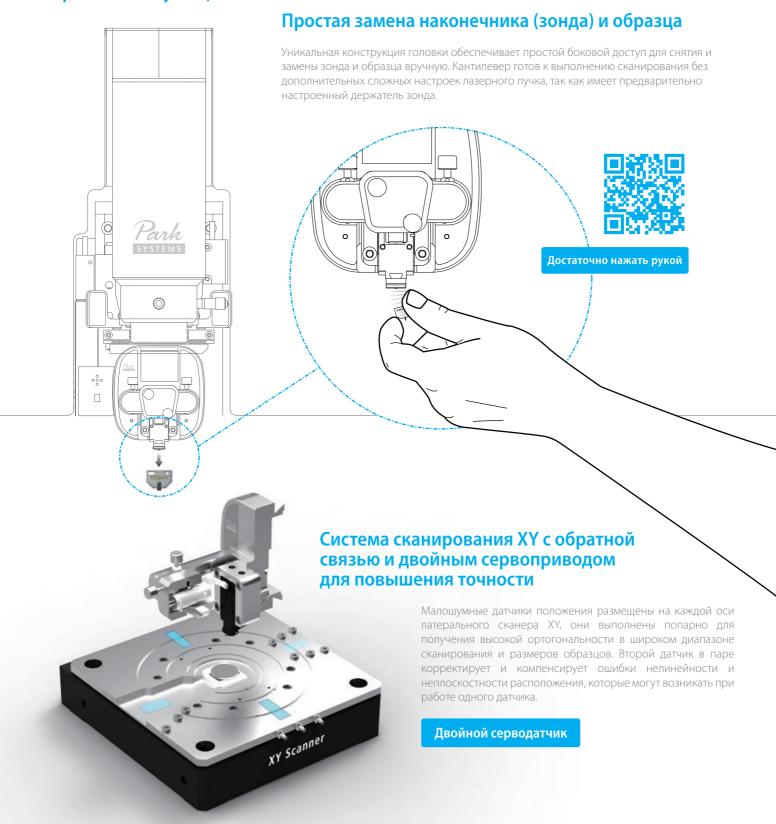
Встроенный режим обработки цифрового сигнала

- 3 канала цифровой фиксации
- Постоянная калибровка пружины (температурный метод)
- Цифровое Q-управление

Встроенные порты доступа сигнала

- Программируемые порты ввода/вывода сигнала
- 7 входов и 3 выхода

Почему самый точный в мире АСМ для работы с крупными образцами очень прост в эксплуатации



Быстрое автоматическое подведение зонда

Наш автоматический механизм подведения зонда к поверхности образца не требует вмешательства пользователя и занимает 10 секунд после загрузки кантилевера. Контролируя реакцию при движении кантилевера вдоль поверхности образца, Park NX20 способен максимально быстро подвести зонд (в течение 10 секунд загрузки кантилевера). Быстрая обратная связь высокоскоростного Z сканера и обработка сигнала с низким уровнем шума электронным контроллером NX обеспечивают необходимый контакт с поверхностью образца без вмешательства оператора. С АСМ можно работать, не прикладывая больших усилий.

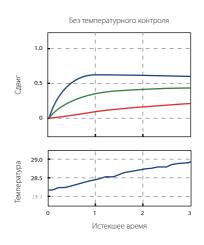


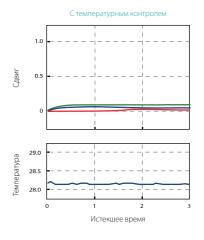
Акустическая камера с активным температурным контролем

Созданная исключительно для микроскопа Park NX20, акустическая камера оснащена режимом активного температурного контроля для создания высоких стабильных температурных характеристик. Park NX20 также имеет активную виброзащиту и полностью изолирован от внешней звуковой среды и света, поэтому ничто не может оказать влияние на точность измерения.

- **Простота использования** инновационный дизайн позволяет Park NX20 быстро достичь температурного баланса
- Ускорение процесса сканирования температурная стабилизация с точностью 0,05 град. достигается в течение 10 минут после закрытия дверцы акустической камеры







Достаточно мощности для любого проекта

С широким диапазоном режимов сканирования и модульной конструкцией Park NX20 располагает мощностью и гибкостью, которые требуются для реализации любого Вашего проекта

Измерение шероховатости поверхности

- Режим True Non-Contact
- Динамический силовой режим

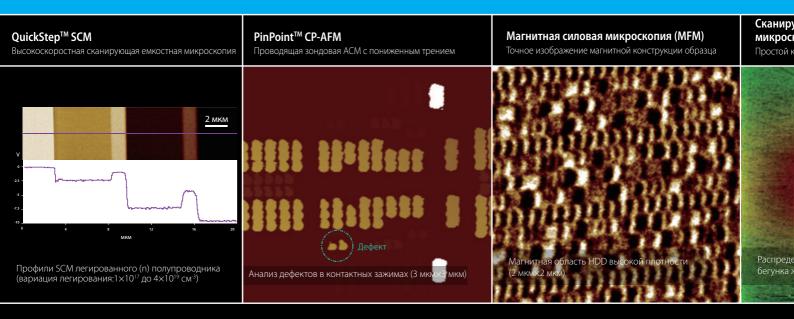
Электрические свойства

- Режим проводимости ACM (ULCA и VECA)
- Электрическая силовая микроскопия (ЕҒМ)
- Пьезоэлектрическая силовая микроскопия (РҒМ)
- Сканирующая микроскопия с зондом Кельвина (SKPM/KPM)
- Сканирующая емкостная микроскопия (SCM)
- Сканирующая микроскопия сопротивления растекания (SSRM)
- Сканирующая туннельная микроскопия (STM)
- Картографирование фототоком по времени (Tr-PCM)

Механические свойства

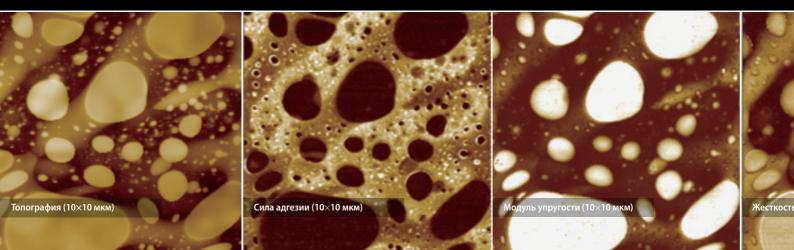
- Силовая спектроскопия F-D
- Объемное силовое изображение
- Силовая модулирующая микроскопия (FMM)
- Латеральная силовая микроскопия (LFM)
- Наноидентификация
- Нанолитография
- Фазовое изображение

Изучение свойств материалов



Наномеханический режим PinPoint, изучение наномеханических свойств

Изображения топографии, силы адгезии, модуля упругости и жесткости композитного материала полистирол-полибутен, полученные одновременно в реальном времени



Опции

Помогают настроить АСМ для облегчения реализации проекта

Автоматическая система сбора и анализа данных экономит время



АСМ NX20 оснащен автоматизированной программой управления, разработанной компанией Park, которая выполняет измерения через АСМ в соответствии с заранее выбранной процедурой (методом). Она осуществляет сбор данных, выполняет распознавание образцов, производит анализ с использованием блока «Содпех» и оптического модуля и экспортирует полученные данные практически без участия оператора. Это экономит Ваше время, которое можно потратить на выполнение исследований.

Магнитные свойства

Температурные свойства

микроскопия (SThM)

• Сканирующая температурная

• Магнитная силовая микроскопия (МFM)

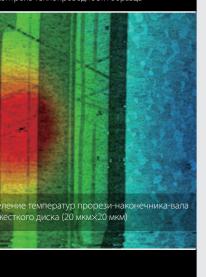
Предметный столик с функцией наклона для получения подробных изображений боковин (боковых стенок)



Инновационная конструкция NX20 позволяет рассмотреть боковину и поверхность образца, измерить угол наклона профилей. АСМ становится еще более универсальным инструментом для проведения исследовательских работ и глубокого изучение внутренних деталей образца.

- Угол наклона: 10°,15° и 20°Размер образца: 20×20 мм
- Толщина образца: 2 мм

ующая температурная копия (SThM) юнтроль теплопроводности образца















Акустическая камера с активным температурным контролем позволит выполнить более точные измерения

- Инновационный дизайн позволяет Park NX20 быстро достичь температурного баланса
- Температурная стабилизация с точностью 0,05 град. достигается в течение 10 минут после закрытия дверцы акустической камеры
- Включает в себя систему защиты от вибраций

Кодирующие устройства для моторизированного столика

- Моторизированный столик XY перемещается с точностью 1 мкм и воспроизводимостью 2 мкм
- Моторизированный столик Z перемещается с точностью 0,1 мкм и воспроизводимостью 1 мкм

Пластины образца

- Малый держатель образца для электрических измерений
- Вакуумные прорези для фиксации подложек
- Размер образца: до 200 мм (стандартно 150 мм)

Крепление чипа в форме клипсы

- Может использоваться с кантилевером без крепления
- Функция отклонения зонда для режимов проводимости АСМ и ЕFM
- Диапазон отклонения зонда: 10 В до 10 В

Сканеры ХҮ

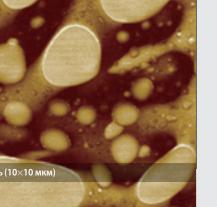
- Латеральный сканер XY 20 мкм×20 мкм
- Латеральный сканер XY 50 мкм×50 мкм
- Латеральный сканер ХҮ 100 мкм×100 мкм

Головки Z-сканера

- Головка сканера Z 15 мкм
- Головка сканера Z 30 мкм

Температурный контроль

- Столик с нагревом и охлаждением (0-180°C)
- Столик с нагревом 250°C
- Столик с нагревом 600°С



Характеристики

-		
Сканер	Латеральный сканер ХҮ	Z сканер
	Консольный одномодульный ХҮ-сканер с замкнутым контуром управления Сканирующий диапазон: 100 мкм×100 мкм, 50 мкм×50 мкм, 25 мкм×25 мкм 20-битный контроль положения и 24-битный датчик положения	Направляющий консольный силовой сканер Сканирующий диапазон: 15 мкм, 30 мкм 20-битный контроль положения и 24-битный датчик положения
Обзор		Линза объектива
	Прямой осевой обзор поверхности образца и кантилевера В сборе с линзой объектива 10 [×] (линза с 20-кратным увеличением опционально) Область обзора: 840×630 мкм ПЗС: 1 Мегапиксель	10° (0,21NA) линза со сверхдлинной рабочей дистанцией 20° (0,42NA) линза с длинной рабочей дистанцией высокого разрешения
Программа	NXP	NXI
	Контроль системы и программа получения данных Регулируемые параметры обратной связи в режиме реального времени Управление скриптами с помощью внешних программ (дополнительно)	Программа для анализа данных АСМ
Электроника	Обработка сигнала	Встроенные функции
	ADC: 18 каналов 4 высокоскоростных ADC канала (64 MSPS) 24-битный ADC для датчика положения сканера X, Y и Z DAC: 12 каналов 2 высокоскоростных DAC канала (64 MSPS) 20-битный DAC для позиционирования сканера X, Y и Z Максимальный размер данных: 4096×4096 пикселей	3 канала гибкого цифрового фиксирующего усилителя Постоянная калибровка пружины (температурный метод) Цифровое Q-управление
Опции/Режимы	Стандартное изображение	Электрические свойства
	 True Non-Contact AFM (реальный бесконтактный режим ACM) Basic Contact AFM (основной контактный режим ACM) Латеральная силовая микроскопия (LFM) Фазное изображение PinPoint AFM Прерывистый (полуконтактный) режим ACM 	 Режим проводимости АСМ Электрическая силовая микроскопия (EFM) Пьезоэлектрическая силовая микроскопия (PFM) Сканирующая микроскопия с зондом Кельвина (SKPM) Сканирующая емкостная микроскопия (SCM)
	Общие свойства	
	 Магнитная силовая микроскопия (MFM) Сканирующая температурная микроскопия (SThM) Силовая спектроскопия F-D Сканирующая туннельная микроскопия (STM) 	Силовая модулирующая микроскопия (FMM)НаноидентификацияНанолитографияНаноманипуляция
	Дополнительные принадлежности	
	 Пластины для образцов Акустическая камера с температурным контролем Ручной пробник для жидкостей Жидкостные элементы Столики с температурным контролем Внешний модуль с функцией наклона Модуль доступа сигнала 	

Предметный столик

Диапазон перемещения ХҮ: 150 мм (200 мм опционально)

Диапазон перемещения Z: 25 мм

Диапазон перемещения фокусировки: 15 мм

Точное кодирующее устройство для всех осей (опционально)

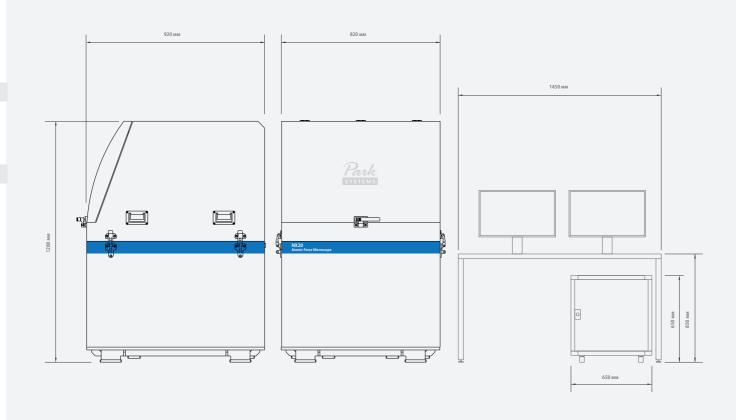
Крепление образца

До 150 мм (в качестве опции 200 мм) Вакуумные прорези для удерживания подложек образцов

Доступ внешнего сигнала

20 встроенных портов ввода/вывода 5 TTL выводов: EOF, EOL, EOP, модуляция и смещение AC

Размеры в мм



Park Systems

Наша миссия – производство самых точных и простых в эксплуатации АСМ

Более четверти века назад компания «Park Systems» была основана в Стэндфордском университете, в котором ее основатель Dr. Sang-il Park работал в группе первых исследователей технологий атомно-силовой микроскопии (ACM). После того как технология была усовершенствована, он участвовал в создании первого коммерческого ACM и затем основал компанию «Park Systems».

Park Systems каждый день реализует инновационный дух своих первопроходцев. За всю свою историю мы получали награды за разработку самых точных АСМ с революционными технологиями и режимами, такими как True Non-Contact™ и программами автоматизации. Мы не просто стремимся к успеху. Вся наша продукция разработана с особой тщательностью и креативностью, чтобы Вы могли сконцентрировать свое внимание на исследовании, не беспокоясь о возможностях приборов.

Международный офис размещен в Корейском Нанотехнологическом центре (КАNС) в Сувоне, Корея.





Хотите узнать больше о нашей продукции? Свяжитесь с одним из наших представителей уже сегодня:

ГОЛОВНЫЕ ОФИСЫ Международный офис +82-31-546-6800 Америка +1-408-986-1110 Япония +81-3-3219-1001 Азия: +65-6634-7470

ОКЕАНИЯ Австралия и Новая Зеландия +61-2-9319-0122 АЗИЯ
Китай +852-2751-9488
Индия +91-40-2404-2353
Индонезия +62-21-384-6464
Малайзия +603-8065-3889
Пакистан +92-51-4444-112
Филиппины +632-807-2712
Саудовская Аравия +966-2-640-5846
Тайвань +886-2-2755-2266
Тайвань +866-2-688-2436
ОАЭ +971-4-339-2603
Вьетнам +844-3556-7371

ЕВРОПА
Франция +33-1-6953-8023
Германия +49-6103-30098-0
Италия +39-02-9009-3082
Израиль +972-3-923-9666
Швейцария +41-34-423-7070
Россия +7 495 221-12-08
Румыния +40(0)-724-157-480
Испания и Португалия +34-902-244-343
Турция +90-312-236-42-0708
Англия и Ирландия +44(0)1372-378-822
Бенилюкс, Скандинавия, страны Балтики +31-184-64-0000

АМЕРИКА США +1-408-986-1110 Канада +1-888-641-0209 Бразилия +55-11-4178-7070 Чили: +56-2-2245-4805 Колумбия: +57-347-0060 Эквадор: +593-2-284-5287 Мексика: +(55) 4544 -4441



Официальный дистрибьютор в России ООО «Промэнерголаб» 107392, Москва, ул. Просторная, д.7 Тел.: +7 495 221-12-08, 8 800 234-12-08 Факс.: +7 495 221-12-08

E-mail: info@czl.ru www.czl.ru

